

# **PLD-Grown Thin Film Saturable Absorbers**

## **Dissertation**

zur Erlangung des Doktorgrades  
des Department Physik  
der Universität Hamburg

vorgelegt von  
**Friedjof Tellkamp**  
aus Wedel

Hamburg  
2012

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. G. Huber Prof. Dr. W. Hansen
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. G. Huber Priv.-Doz. Dr. V. Baev
Datum der Disputation:	24.02.2012
Vorsitzender des Prüfungsausschusses:	Prof. Dr. P. Schmelcher
Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. P. Hauschildt
Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften:	Prof. Dr. H. Graener

Berichte aus der Physik

**Friedjof Tellkamp**

**PLD-Grown Thin Film Saturable Absorbers**

Shaker Verlag  
Aachen 2012

**Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek**

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at <http://dnb.d-nb.de>.

Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2012

Copyright Shaker Verlag 2012

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

Printed in Germany.

ISBN 978-3-8440-1189-0

ISSN 0945-0963

Shaker Verlag GmbH • P.O. BOX 101818 • D-52018 Aachen

Phone: 0049/2407/9596-0 • Telefax: 0049/2407/9596-9

Internet: [www.shaker.de](http://www.shaker.de) • e-mail: [info@shaker.de](mailto:info@shaker.de)

# Abstract

FRIEDJOF TELLKAMP: *PLD-Grown Thin Film Saturable Absorbers*

The subject of this thesis is the preparation and characterization of thin films made of oxidic dielectrics which may find their application as saturable absorber in passively Q-switched lasers. The solely process applied for fabrication of the thin films was the pulsed laser deposition (PLD) which stands out against other processes by its flexibility considering the composition of the systems to be investigated. Within the scope of this thesis the applied saturable absorbers can be divided into two fundamentally different kinds of functional principles:

On the one hand, saturable absorption can be achieved by ions embedded in a host medium. Most commonly applied bulk crystals are certain garnets like YAG ( $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ ) or the spinel forsterite ( $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$ ), in each case with chromium as dopant. Either of these media was investigated in terms of their behavior as PLD-grown saturable absorber. Moreover, experiments with  $\text{Mg}_2\text{GeO}_4$ ,  $\text{Ca}_2\text{GeO}_4$ ,  $\text{Sc}_2\text{O}_3$ , and further garnets like YSAG or GSGG took place. The absorption coefficients of the grown films of  $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$  were determined by spectroscopic investigations to be one to two orders of magnitude higher compared to commercially available saturable absorbers. For the first time, passive Q-switching of a Nd:YAG laser at 1064 nm with  $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$  thin films could be realized as well as with  $\text{Cr}:\text{Sc}_2\text{O}_3$  thin films.

On the other hand, the desirable effect of saturable absorption can also be generated by quantum well structures. For this purpose, several layer system like YAG/LuAG,  $\text{Cu}_2\text{O}/\text{MgO}$ , and  $\text{ZnO}/\text{corundum}$  were investigated. It turned out that layer systems with indium oxide ( $\text{In}_2\text{O}_3$ ) did not only grew in an excellent way but also showed up a behavior regarding their photo luminescence which cannot be explained by classical considerations. The observed luminescence at roughly 3 eV (410 nm) was assumed to be of excitonic nature and its increasing oscillator strength against thinner films was assumed to be due to confining.

The grown thin films were structurally investigated with Reflection High-Energy Electron Diffraction (RHEED). It could be observed that the applied cubic systems like  $\text{Sc}_2\text{O}_3$ ,  $\text{In}_2\text{O}_3$ , or YAG kept the orientation of the substrate, thus they are said to grow in an epitaxial way. Considering thin films of  $\text{Cr}:\text{Sc}_2\text{O}_3$ , one could observe epitaxial Frank-van der Merwe growth (layer-by-layer) even after the growth of films with thicknesses in a macroscopic scale.

The appearance of particulates is a major drawback when preparing thin films by pulsed laser deposition. Within this thesis, the deposition process could considerably be improved by the implementation of a velocity filter. Despite the filter's installation one could still make use of the measurement equipment like pyrometer, reflectometer, and the RHEED system. Furthermore, the existing facility was improved in such a way that the growth of multilayered systems was possible with only little effort which significantly simplified the growth of the mentioned quantum well structures.

## Kurzfassung

FRIEDJOF TELLKAMP: *Mittels PLD hergestellte dünne Schichten als sättigbare Absorber*

Gegenstand dieser Arbeit ist die Herstellung und Charakterisierung von dünnen Schichten aus oxidischen Dielektrika, welche als sättigbare Absorber ihre Anwendung unter anderem in passiv gütgeschalteten Lasern finden. Der für die Herstellung der dünnen Schichten ausschließlich verwendete Prozess ist das Laserstrahlverdampfen (Pulsed Laser Deposition, PLD), welcher sich von anderen Prozessen insbesondere durch seine Flexibilität bezüglich der Zusammensetzung der abzuscheidenden Schichtsysteme unterscheidet. Die im Rahmen dieser Arbeit zur sättigbaren Absorption verwendeten Materialien lassen sich in zwei grundlegende Funktionsprinzipien unterteilen:

Einerseits kann sättigbare Absorption durch in Wirtsmaterialien eingebettete Ionen erzielt werden. Hierfür übliche Volumenkristalle sind YAG ( $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ ) oder das Spinell Forsterit ( $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$ ), jeweils mit Chrom als Dotierung. Diese Materialien wurden auf ihre Eigenschaften als mittels PLD hergestellte sättigbare Absorber hin untersucht. Des Weiteren fanden Versuche mit Wirtsmaterialien wie  $\text{Mg}_2\text{GeO}_4$ ,  $\text{Ca}_2\text{GeO}_4$ ,  $\text{Sc}_2\text{O}_3$  und weiteren Vertretern der Granatgruppe (YSAG, GSGG) statt. Die spektroskopischen Analysen der Schichten aus  $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$  ergaben, dass deren Absorptionskoeffizienten um ein bis zwei Größenordnungen über denen von handelsüblichen Volumenkristallen liegen können. Erstmals konnte passive Güteschaltung eines Nd:YAG Lasers bei 1064 nm mit Schichten aus  $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$  realisiert werden, ebenso wie mit den Schichten aus  $\text{Cr}:\text{Sc}_2\text{O}_3$ .

Andererseits lässt sich der gewünschte Effekt der sättigbaren Absorption auch durch Quantentopfstrukturen (quantum wells) herbeiführen. Hierfür wurden verschiedenste Schichtsysteme untersucht, unter anderem YAG/LuAG,  $\text{Cu}_2\text{O}/\text{MgO}$  und  $\text{ZnO}/\text{Korund}$ . Es stellte sich heraus, dass Systeme mit dünnen Schichten aus Indiumoxid ( $\text{In}_2\text{O}_3$ ) sich nicht nur exzellent auf  $\text{Sc}_2\text{O}_3$ , Korund oder Silicium aufwachsen lassen, sondern auch bezüglich ihrer Photolumineszenz Verhalten aufzeigen, die mit klassischen Betrachtungsweisen nicht erkläbar sind. Es wird angenommen, dass eine beobachtete Lumineszenz bei ca. 3 eV (410 nm) von exitonischer Natur ist und deren sich erhöhende Oszillatiorstärke gegen dünner werdende Schichten durch Confinement hervorgerufen wird.

Mittels Reflection High-Energy Electron Diffraction (RHEED) wurden die Schichten *in situ* auf ihre strukturellen Eigenschaften hin untersucht. Bei den verwendeten kubischen Systemen wie  $\text{Sc}_2\text{O}_3$ ,  $\text{In}_2\text{O}_3$  oder YAG konnte eine Beibehaltung der Orientierung des Substrates beobachtet werden, demnach wuchsen diese Systeme epitaktisch auf. Bei Schichten aus  $\text{Cr}:\text{Sc}_2\text{O}_3$  konnte epitaktisches Frank-van der Merwe-Wachstum (layer-by-layer) auch bei makroskopischen Dicken beobachtet werden.

Ein Nachteil der Schichtherstellung mittels PLD ist die Ablagerung von Partikeln. Hier konnte der Prozess durch den Einbau eines Geschwindigkeitsfilters deutlich verbessert werden. Trotz des Einbaus des Filters waren Messungen mit Pyrometer, Reflektometer und dem RHEED-System weiterhin möglich. Außerdem wurde die bestehende PLD Anlage derart ausgebaut, dass Multilagenwachstum von dünnen Schichten mit geringem Aufwand möglich ist, welches insbesondere das Aufwachsen der genannten Quantentopfstrukturen erheblich vereinfacht hat.

# Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
1.1	Motivation . . . . .	1
1.2	Structure of this Thesis . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Fundamentals</b>	<b>3</b>
2.1	Theory of Saturable Absorbers . . . . .	3
2.1.1	Interaction of Radiation and Matter . . . . .	3
2.1.2	Saturable Absorption . . . . .	4
2.1.3	Passive Q-Switching . . . . .	7
2.1.4	Passive Mode Locking . . . . .	12
2.2	Thin Film and Substrate Materials . . . . .	14
2.2.1	Corundum . . . . .	14
2.2.2	Sesquioxides . . . . .	14
2.2.3	Garnets . . . . .	16
2.2.4	Spinels . . . . .	17
2.2.5	Other Materials . . . . .	19
<b>3</b>	<b>Analytical Techniques</b>	<b>21</b>
3.1	Reflectometry . . . . .	21
3.1.1	Transfer Matrix Method . . . . .	22
3.1.2	Reflectivity of Thin Films . . . . .	23
3.2	Reflection High-Energy Electron Diffraction . . . . .	25
3.2.1	Geometrical Considerations . . . . .	27
3.2.2	RHEED Tracking . . . . .	29
3.3	X-Ray Diffraction . . . . .	30
3.4	Microscopy . . . . .	32
3.4.1	Optical Microscopy . . . . .	32
3.4.2	Atomic Force Microscopy . . . . .	33
3.5	Spectroscopy . . . . .	35
3.5.1	Absorption of Films . . . . .	35
3.5.2	Photoluminescence Measurements . . . . .	37
3.5.3	VUV Photoluminescence Measurements . . . . .	38
<b>4</b>	<b>Pulsed Laser Deposition</b>	<b>39</b>
4.1	Introduction . . . . .	39
4.2	The PLD Setup . . . . .	40

## Contents

4.3	Growth Mechanisms . . . . .	42
4.4	Thin Film Preparation . . . . .	43
4.4.1	Lattice Matching . . . . .	43
4.4.2	Substrate Preparation . . . . .	44
4.4.3	Target Preparation . . . . .	44
4.4.4	Thin Film Growth and Effects . . . . .	45
4.5	Absorption Processes and the Generation of Particulates . . . . .	48
<b>5</b>	<b>Technical Improvements</b>	<b>51</b>
5.1	Diode Laser Heating . . . . .	51
5.1.1	Installation and Setup . . . . .	52
5.1.2	Heat Distribution . . . . .	53
5.2	Preparation of Stratified Media . . . . .	54
5.3	Vane Velocity Filter . . . . .	55
5.3.1	Reduction of Particulates . . . . .	55
5.3.2	Velocity Distribution at PLD . . . . .	57
5.3.3	Implementation and Results . . . . .	58
5.4	Conclusion . . . . .	61
<b>6</b>	<b>Preparation and Characterization of Ionic Saturable Absorbers</b>	<b>63</b>
6.1	Chromium Doped Garnets . . . . .	63
6.1.1	Thin Film Preparation . . . . .	65
6.1.2	Spectroscopic Characterization . . . . .	69
6.1.3	Cr:YAG Thin Films for a Passively Q-Switched Laser . . . . .	72
6.1.4	Scandium Garnets . . . . .	77
6.2	Vanadium Doped Garnets . . . . .	78
6.2.1	Thin Film Preparation . . . . .	79
6.2.2	Spectroscopic Characterization . . . . .	80
6.3	Chromium Doped Spinels . . . . .	81
6.3.1	Thin Film Preparation . . . . .	81
6.3.2	Spectroscopic Characterization . . . . .	82
6.4	Chromium Doped Scandia . . . . .	85
6.4.1	Thin Film Preparation and Characterization . . . . .	85
6.4.2	Chromium Doped Scandia for a Passively Q-Switched Laser . . . . .	89
6.5	Summary and Discussion . . . . .	90
<b>7</b>	<b>Novel Materials Towards Saturable Absorption by Quantum Confinement</b>	<b>93</b>
7.1	Theoretical Aspects . . . . .	94
7.1.1	Electronic Band Structure . . . . .	94
7.1.2	Absorption Processes . . . . .	96
7.1.3	Excitons . . . . .	97
7.1.4	Confinement . . . . .	98
7.2	Overview of Selected Materials . . . . .	98
7.2.1	YAG on LuAG . . . . .	99

7.2.2	Cuprous Oxide on Magnesia . . . . .	100
7.2.3	Zinc Oxide on Corundum . . . . .	102
7.3	Epitaxial Growth of Indium Oxide on Sesquioxide Substrates . . . . .	102
7.3.1	Thick Films of Indium Oxide . . . . .	103
7.3.2	Thin Films of Indium Oxide . . . . .	106
7.4	Growth of Indium Oxide on Corundum . . . . .	107
7.4.1	Thin Film Preparation . . . . .	107
7.4.2	Spectroscopic Characterization . . . . .	108
7.5	Growth of Scandia and Indium Oxide on Silicon . . . . .	111
7.5.1	Thin Film Preparation . . . . .	111
7.5.2	Spectroscopic Characterization . . . . .	114
7.6	Summary and Discussion . . . . .	116
<b>8</b>	<b>Conclusion</b>	<b>119</b>
8.1	Summary and Results . . . . .	119
8.2	Outlook . . . . .	120
<b>A</b>	<b>References to Material Parameters</b>	<b>123</b>
<b>B</b>	<b>Reflectivity of Scattering Thin Films</b>	<b>125</b>
<b>C</b>	<b>Particulate Counting Algorithm</b>	<b>127</b>



# List of Figures

2.1	Absorption, Spontaneous Emission and Stimulated Emission . . . . .	4
2.2	Energy Level Schemes of a Four-Level Laser and a Saturable Absorber . . . . .	8
2.3	Simulation Charts of a Passively Q-switched Nd:YAG laser . . . . .	11
2.4	Mechanisms of Mode Locking . . . . .	13
2.5	Unit Cell of the Bixbyite Structure . . . . .	15
3.1	Layer Definition at the Transfer Matrix Method . . . . .	22
3.2	RHEED Setup . . . . .	27
3.3	RHEED Pattern Examples . . . . .	29
3.4	Definition of Angles at the $\theta$ - $2\theta$ -scan . . . . .	31
3.5	Optical Microscopy Image of Particulates on Thin Films . . . . .	33
3.6	Atomic Force Microscopy Setup . . . . .	33
3.7	Spectral Transmission of a Cr:YSAG Film on YAG . . . . .	36
4.1	PLD setup . . . . .	40
4.2	Thin Film Growth Modes . . . . .	42
4.3	Definition of the Wetting Angle . . . . .	42
4.4	RHEED Patterns after Homoepitaxial Deposition of YAG . . . . .	45
4.5	Substrate Pretreatment Reflectometer Charts . . . . .	47
5.1	Diode Laser Heating Setup . . . . .	52
5.2	Temperature Profile of a Diode Laser Heated Substrate . . . . .	54
5.3	Sketch and Technical Drawing of the Vane Velocity Filter . . . . .	58
5.4	Particulate Reduction by Vane Velocity Filter . . . . .	59
5.5	Particulate Surface Density vs. Cut-Off Velocity . . . . .	60
5.6	Particulate Velocity Distribution and Filter Wheel Transmissions . . . . .	60
6.1	Energy Level Scheme of $\text{Cr}^{4+}\text{:YAG}$ . . . . .	64
6.2	RHEED Intensity Tracking of a Cr:YAG Thin Film Grown on YAG . . . . .	68
6.3	X-Ray Diffraction Pattern of a Cr:YAG Thin Film Grown on YAG . . . . .	68
6.4	Absorption Spectra of Cr:YAG Films Grown at Different Oxygen Partial Pressures . . . . .	70
6.5	Absorption Spectrum of an Annealed Cr:YAG Film . . . . .	71
6.6	Schematics of the Q-Switched Laser Setup . . . . .	72
6.7	Oscilloscope Charts for Q-Switched Lasers with $\text{Cr}^{4+}\text{:Cr:YAG}$ Films as Saturable Absorber . . . . .	73

## List of Figures

6.8	Input-Output Characteristics for Q-Switched Lasers with Cr <sup>4+</sup> :Cr:YAG Films as Saturable Absorber . . . . .	74
6.9	Absorption Spectrum and RHEED Patterns of a Cr:YSAG Thin Film . . . . .	77
6.10	Absorption Spectrum of a V <sup>3+</sup> :YAG Thin Film on YAG . . . . .	80
6.11	X-Ray Diffraction Patterns of Chromium Doped Spinel Thin Films . . . . .	83
6.12	Absorption Spectra of Chromium Doped Spinel Thin Films . . . . .	84
6.13	RHEED Tracking Chart of a Cr:Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Film on Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	86
6.14	AFM Image and Height Profile of a Cr:Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Film on Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	86
6.15	Optical Microscope Image of a Cr:Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Film on Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	87
6.16	Absorption Spectrum of a Cr:Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Film on Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	88
6.17	Oscilloscope Chart for a Q-Switched Laser with a Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Film as Saturable Absorber . . . . .	89
6.18	Input-Output Characteristics for a Q-Switched Laser with a Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Film as Saturable Absorber . . . . .	90
6.19	Tetrahedral Cr <sup>4+</sup> Concentration in Cr <sup>4+</sup> :YAG vs. Oxygen Partial Pressure	90
7.1	Simplified Electronic Band Structure and Fermi-Dirac Distribution . . . . .	95
7.2	Absorption Spectra of Cu <sub>2</sub> O Thin Films on MgO . . . . .	101
7.3	Reflectometer Chart, Absorption and PL Spectra for In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Thin Films . . . . .	104
7.4	RHEED Patterns of an In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Film Grown on Corundum . . . . .	108
7.5	Absorption Spectra of In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Films Grown on Corundum . . . . .	109
7.6	PL Spectra of In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Films Grown on Corundum . . . . .	110
7.7	Schematics of Multilayered Structures Grown on Silicon . . . . .	112
7.8	X-Ray Diffraction Patterns of In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Films Grown on Silicon . . . . .	113
7.9	PL Spectra of In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Films Grown on Silicon . . . . .	115
7.10	PL Excitation Spectra of In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Films Grown on Silicon . . . . .	116
B.1	Reflectivity of Scattering Thin Films . . . . .	125

# List of Tables

2.1	Corundum, Sesquioxides and Indium Oxide Material Parameters . . . . .	15
2.2	Garnet Material Parameters . . . . .	18
2.3	Spinel Material Parameters . . . . .	18
2.4	Other Material Parameters . . . . .	20
4.1	Deposition Parameters and Outcomes of Homoepitaxially Grown YAG Films	46
5.1	Investigated Materials for Heat Spreading . . . . .	53
6.1	Parameters of PLD-Grown Cr <sup>4+</sup> :YAG Thin Films on YAG . . . . .	66
6.2	Absorption Spectra Peak Positions of Cr:YAG Films on YAG . . . . .	70
6.3	Experimental and Simulated Data of Q-Switched Lasers with Cr:YAG Films as Saturable Absorbers . . . . .	76
6.4	Deposition Parameters and Outcomes of Vanadium Doped Garnet Films .	79
6.5	Deposition Parameters and Outcomes of Chromium Doped Spinel Films .	81
7.1	Overview of Investigated Materials for Quantum Confined Systems . . . . .	99
7.2	Overview of Grown Cu <sub>2</sub> O Thin Films on MgO . . . . .	100
7.3	Overview of In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Films Grown on LuScO <sub>3</sub> . . . . .	106
7.4	Overview of In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Films Grown on Corundum . . . . .	107
7.5	Overview of In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Films Grown on Silicon . . . . .	112
A.1	References I . . . . .	123
A.2	References II . . . . .	123
A.3	References III . . . . .	124
A.4	References IV . . . . .	124